

Адсорбция газообразного гелия вблизи T_λ при низких давлениях

Г. В. Качалин, А. П. Крюков, С. Б. Нестеров

Московский энергетический институт (Технический университет),
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 14
E-mail: kryukov@kryos.mpeii.ac.ru

Проведено экспериментальное исследование криосорбции изотопов гелия ^4He и ^3He при низких давлениях газа в объеме на тонких слоях твердого аргона при изменении температуры слоя от 4,2 до 2 К. Показано, что изостера сорбции ^4He имеет аномальный характер вблизи температуры перехода жидкого ^4He в сверхтекучее состояние T_λ . Резкое изменение давления наблюдается при толщине пленки ^4He , соответствующей примерно двум монослоям. В экспериментах по криосорбции газообразного ^3He на слое аргона при толщине пленки ^3He , соответствующей примерно одному монослою, давление в объеме изменяется монотонно во всем температурном интервале.

Проведено експериментальне дослідження кріосорбції ізотопів гелію ^4He и ^3He при низьких тисках газу в об'ємі на тонких шарах твердого аргону при змінюванні температури шару від 4,2 до 2 К. Показано, що ізостера сорбції ^4He має аномальний характер поблизу температури переходу рідкого ^4He в надплинний стан T_λ . Різке змінювання тиску спостерігається при товщині плівки ^4He , яка відповідає приблизно двом моношарам. В експериментах по кріосорбції газоподібного ^3He на шарі аргону при товщині плівки ^3He , яка відповідає приблизно одному моношару, тиск в об'ємі змінюється монотонно у всьому температурному інтервалі.

PACS: 67.70.+n

Введение

В последние годы опубликовано много работ, посвященных изучению свойств тонких слоев гелия, адсорбированного на различных пористых веществах: стеклах, силикагелях, аэрогелях и цеолитах [1–8]. Однако процессы адсорбции газообразного гелия на твердой поверхности при низком начальном давлении в газообразном гелии исследованы недостаточно подробно.

Целью представленной работы является изучение поведения изостер сорбции изотопов гелия на криослоях аргона при температурах вблизи точки перехода жидкого ^4He в сверхтекучее состояние T_λ .

Методика проведения эксперимента

Эксперименты по исследованию криосорбции гелия вблизи T_λ выполнялись на высоковакуумной установке, позволяющей проводить измерения в области низких температур. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, a, б.

Основным элементом установки является криоблок, состоящий из серийного гелиевого

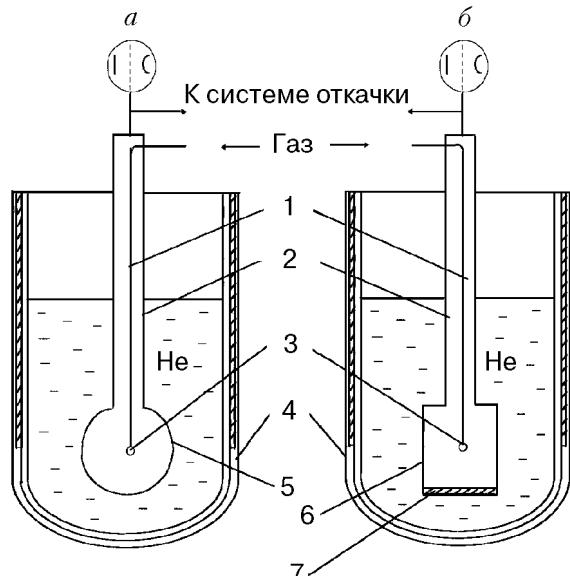


Рис. 1. Сферический (a) и цилиндрический (б) экспериментальные модули: 1 – трубка напуска газа; 2 – соединительный трубопровод; 3 – распылитель; 4 – гелиевый криостат; 5 – полая сфера; 6 – полый цилиндр; 7 – основание

криостата КГ-60/300-1 и помещенного в него вакуумного модуля. Вакуумный модуль представляет собой медную сферу диаметром 270 мм и толщиной стенки 1 мм (рис. 1, а) либо цилиндр со съемной криопанелью (рис. 1, б).

Применение сферического модуля продиктовано стремлением обеспечить равномерность нанесения слоя сорбента на поверхность криопанели. Однако в земных условиях из-за гидростатического давления лямбда-переход в верхней части сферы произойдет при несколько более высокой температуре, чем в нижней. Такой разности температур вдоль криопанели можно избежать при использовании цилиндрического модуля с плоской криопанелью. Но в этом случае не удается осуществить равномерное нанесение сорбента. Из приведенного краткого рассмотрения следует, что в принципе, а не только в данном эксперименте, применение сферического модуля в условиях невесомости при проведении прецизионных измерений температуры позволит добиться равномерности слоя сорбента при идеальной изотермичности вблизи лямбда-перехода.

Вакуумный модуль предварительно откачивается через соединительный трубопровод с помощью внешнего поста, состоящего из турбомолекулярного насоса ВМН-150 и механического насоса 2НВР-5ДМ. Затем в криостат заливают жидкий гелий. Уровень жидкого гелия в ванне контролируют с помощью уровнемеров из сверхпроводящей проволоки.

Криослой сорбента (в данном случае аргона) формируется в результате конденсации газа на

внутренней поверхности вакуумного модуля. Газ подается через трубку напуска, снабженную распылителем, состоящим из трех слоев сетки с размером ячейки 64 мкм, который позволяет формировать криослой одинаковой толщины. После формирования криослоя заданной толщины производится напуск газообразного гелия. Содержание гелия определяется в относительных единицах $C = (V_{\text{He}}/V_{\text{Ar}}) \cdot 100\%$, где V_{He} и V_{Ar} – соответственно объемы газообразного гелия и аргона при нормальных условиях.

После установления равновесного давления в газообразном гелии над криослоем при $T = 4,2 \text{ K}$ определяется изостера сорбции, т.е. исследуется зависимость $\ln P = f_c(1/T)$ (P – давление гелия над криослоем; T – температура криослоя) при постоянном содержании гелия в объеме модуля. Давление определяется при помощи ионизационных преобразователей давления ЛМ-З-2. Температуру ванны изменяют откачкой паров жидкого гелия, омывающего вакуумный модуль. Величина T определяется по давлению насыщенных паров жидкого гелия, измеряемого ртутным чашечным манометром, а также контролируется по показателям термометров сопротивления, укрепленных с внешней стороны вакуумной камеры.

Изостера сорбции в координатах $\ln P - T^{-1}$ является прямой линией, тангенс угла наклона которой определяет величину теплоты сорбции.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости $\lg P = f_c(1/T)$ при измерении сорбции гелия для изотопов гелия ^4He и ^3He ,

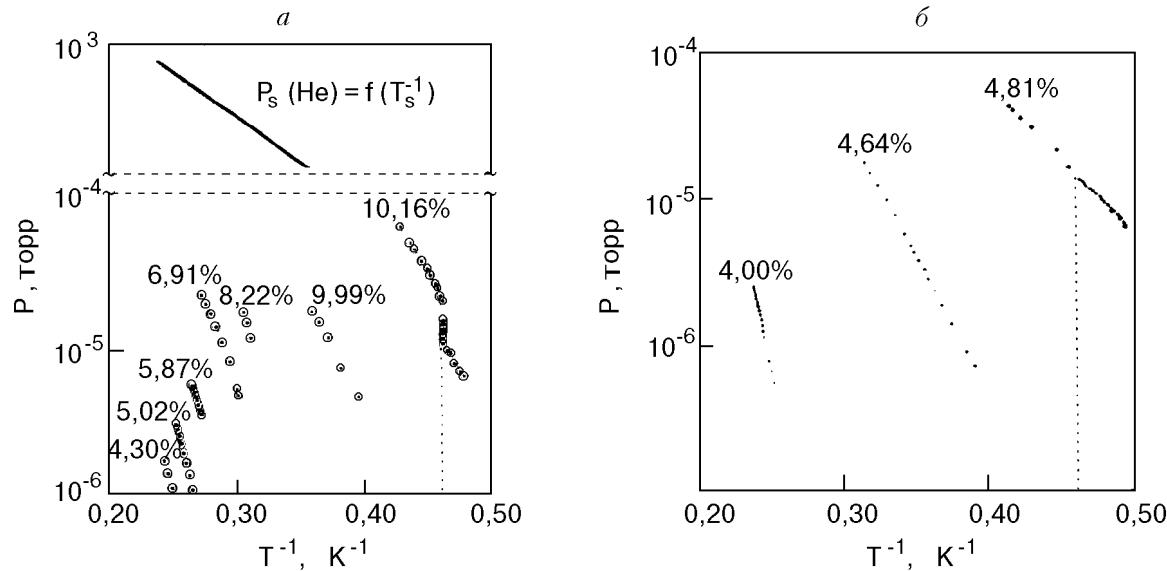


Рис. 2. Изостеры сорбции ^4He (а) и ^3He (б) на криослое аргона при различных концентрациях гелия, C (%).

полученные на криослоях аргона, сформированных в идентичных условиях (сферический модуль).

Как видно на рис. 2, вблизи точки фазового перехода ${}^4\text{He}$ в наружной ванне в сверхтекущее состояние $T_\lambda = 2,172 \text{ К}$ давление P газообразного ${}^4\text{He}$ над криослоем скачком уменьшается примерно в два раза (см. изостеру для $C = 10,16\%$).

В том же температурном интервале давление газообразного ${}^3\text{He}$ монотонно изменяется с понижением температуры, так что изостера сорбции ${}^3\text{He}$ для $C = 4,81\%$ описывается прямой линией. Таким образом, анализ рис. 2 показывает, что наблюдаемый скачок давления характеризует поведение системы Ar— ${}^4\text{He}$ при $C = 10,16\%$.

Для интерпретации экспериментальных данных необходимы сведения о свойствах поглощающей подложки, в частности о концентрации гелия C , при которой на поверхности твердого аргона формируется монослой гелия, т.е. о величине емкости монослоя. Для оценки емкости монослоя мы использовали уравнения Ленгмюра, Брунауэра—Эммета—Теллера (БЭТ) и Дубинина—Радушкевича—Каганера (ДРК) [9–12]. Знание величины емкости монослоя необходимо для понимания процессов, происходящих на поверхности криослоя при понижении температуры.

В диапазоне концентраций 3,40–5,87% для ${}^4\text{He}$ и 4,00–4,81% для ${}^3\text{He}$ все три уравнения — Ленгмюра, БЭТ и ДРК — удовлетворительно описывают экспериментальные зависимости $P(T)$.

Расчетные значения емкости монослоя аргона при сорбции ${}^4\text{He}$ и ${}^3\text{He}$ представлены в таблице. Видно, что значения емкости монослоя C_m , определенные различными методами, для ${}^4\text{He}$ и ${}^3\text{He}$ на аргоне достаточно близки и лежат в пределах $C_m = 4,94\text{--}6,09\%$ для ${}^4\text{He}$ и 4,81–5,3% для ${}^3\text{He}$. Отсюда следует, что толщина пленки ${}^4\text{He}$ на поверхности аргона в условиях, когда наблюдается скачок давления на прямой $\lg P = f(1/T)$ вблизи T_λ , соответствует примерно двум монослоям.

Таблица

Концентрация гелия C в аргоне, при которой на поверхности твердого аргона формируется монослой гелия

Уравнение	Концентрация, %	
	${}^4\text{He}$	${}^3\text{He}$
ДРК	4,94	5,3
Ленгмюра	6,09	4,81

БЭТ	5,84	4,81
-----	------	------

Скачкообразное падение давления газообразного ${}^4\text{He}$ в рабочем объеме при охлаждении жидкости ниже T_λ может быть объяснено следующим образом.

Известно [5], что даже тонкие пленки гелия, образованные в результате сорбции на поверхности твердого тела, весьма подвижны в отличие от адсорбированных слоев других газов. В работе [6] показано, что слой аргона, осажденного на поверхности меди, обладает достаточно высокой теплопроводностью, чтобы эффективно отводить выделяющееся в ходе адсорбции гелия тепло. Исследования [7] показали, что температура перехода в сверхтекущее состояние жидкого ${}^4\text{He}$, содержащегося в порах такого сорбента, как аэрогель, составляет 2,167 К, т.е. близко к соответствующему значению T_λ для массивной жидкости. В недавно опубликованной работе [8] приведены экспериментальные данные, из которых следует, что теплопроводность ненасыщенных гелиевых пленок на поверхности пористого стекла резко (на четыре порядка) возрастает при повышении концентрации атомов ${}^4\text{He}$ на поверхности или понижении температуры подложки. В частности [8], при концентрации 34,7 мкмоль $\text{He}/\text{м}^2$ это происходит при температуре $\sim 1,1 \text{ К}$.

Основываясь на перечисленных экспериментальных данных, резкое уменьшение давления газообразного ${}^4\text{He}$ над слоем аргона при охлаждении рабочего объема ниже T_λ можно связать со значительным увеличением подвижности адсорбированной на поверхности аргона гелиевой пленки и проникновением гелия в тонкие поры. Это приводит к увеличению сорбционной емкости слоя сорбента и соответственно смещению динамического равновесия в сторону уменьшения объемной концентрации атомов ${}^4\text{He}$ в газе над криослоем. Практически одинаковый наклон изостер до и после скачка давления свидетельствует о том, что после заполнения микропор теплота сорбции не изменяется.

Выводы

- При криосорбции ${}^4\text{He}$ на слое твердого аргона обнаружено аномальное поведение изостеры сорбции в районе фазового перехода жидкости в объеме, которое выражается в скачкообразном изменении давления над криослоем. Обработка данных в координатах

уравнений Ленгмюра, Брунауэра—Эммета—Теллера и Дубинина—Радушкевича—Каганера показала, что аномальное поведение наблюдается при толщине гелиевой пленки, соответствующей примерно двум монослоям.

2. В случае криосорбции ^3He на слое аргона, сформированном в идентичных условиях, при емкости, соответствующей примерно одному монослою, резкое изменение давления над криослоем в районе T_λ для ^4He в большом объеме не наблюдается.

Работа выполнена в рамках проекта TM-16 в соответствии с контрактом NAS 15-10110 между NASA и Российским космическим агентством.

1. L. S. Gurevich, S. B. Nesterov, A. P. Kryukov, and A. I. Bychkov, *Plasma Devices and Operations* **1**, 247 (1991).
2. С. Б. Нестеров, А. П. Крюков, *ВАНТ. Сеп. Термоядерный синтез*, 134 (1994).
3. E. Wallen, *J. Vac. Sci. Technol. A15(2)*, 265 (1997).
4. S. B. Nesterov and A. P. Kryukov, *Vacuum*, to be published.
5. F. D. Manchester, *Rev. Mod. Phys.* **39**, 383 (1967).
6. W. D. McCormick, D. L. Goodstein, and J. G. Dash, *Phys. Rev.* **168**, 249 (1968).
7. M. H. W. Chan, K. I. Blum, S. Q. Murphy, G. K. S. Wong, and J. D. Reppy, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 1950 (1988).

8. M. Kubota, T. Yano, T. Iida, G. Ueno, V. Kovacik, and M. K. Zalalutdinov, *Czech. J. Phys.* **46**, 437 (1996).
9. I. Langmuir, *J. Am. Chem. Soc.* **40**, 1361 (1918).
10. S. Brunauer, P. H. Emmett, and E. Teller, *J. Am. Chem. Soc.* **60**, 309 (1938).
11. M. M. Dubinin and L. V. Radushkevich, *Proc. Acad. Sci. USSR* **55**, 327 (1947).
12. M. G. Kaganer, *Proc. Acad. Sci. USSR* **116**, 603 (1957).

Adsorption of helium gas near T_λ at low pressures

G. V. Kachalin, A. P. Kryukov, and S. B. Nesterov

Cryosorption of helium isotopes (^4He and ^3He) on thin argon cryolayers is studied experimentally in the temperature range 4.2–2 K at low pressures. It is shown that the sorption isostere ^4He is anomalous at temperatures close to the temperature of the phase transition in the bulk of ^4He , T_λ . An abrupt pressure change is observed for a ^4He film thickness approximately equal to two monolayers. The experiments on cryosorption of ^3He gas on an argon layer with a ^3He film thickness of approximately one monolayer display monotonous changes in the pressure within the whole temperature range.